

Sitzung 1: Normale, Kalibrierung, Messunsicherheit

<p><i>P. H. Osanna, M. N. Durakbasa, A. Afjehi-Sadat</i></p>	<p>Nano-Metrologie als wissenschaftliche Disziplin in der praktischen Anwendung und im Blickpunkt der europäischen internationalen Standardisierung</p>	<p>3</p>
<p><i>M. Ritter, T. Dziomba, M. Xu, L. Koenders, A. Kranzmann</i></p>	<p>Eine neue 3D Kalibrierstrategie für Mikro- und Nanomessverfahren</p>	<p>15</p>
<p><i>E. Gärtner, J. Frühauf</i></p>	<p>Silizium-Normale für die Tiefen-, Längen- und Rauheitsmesstechnik</p>	<p>25</p>
<p><i>E. Reithmeier, J. Frühauf, M. Rahlves, A. Kraft, M. Seifert</i></p>	<p>Heißprägen multifunktionaler Kalibriernormale für die optische 3D Mikroskopie Beurteilung gerätespezifischer Eigenschaften</p>	<p>35</p>
<p><i>Th. Wiedenhöfer, A. Weckenmann</i></p>	<p>Modulare Modellbildung bei der Messunsicherheitsermittlung in der Mikro- und Nanomesstechnik</p>	<p>45</p>

Sitzung 2: Nanomess- und Positioniertechnik

<p><i>G. Jäger, E. Manske, T. Hausotte, R. Mastylo, N. Dorozhovets, N. Hofmann</i></p>	<p>Taktile und optische Sensorsysteme für Nanomess- und Nanopositioniermaschinen</p>	<p>55</p>
<p><i>R. Thalmann, F. Meli, A. Küng</i></p>	<p>Taktile Mikro-Koordinatenmesstechnik an den Grenzen</p>	<p>67</p>
<p><i>M. de Campos Porath, K. Seitz</i></p>	<p>Untersuchungen zum Genauigkeitsnachweis an einem Koordinatenmessgerät für mikromechanische Bauteile</p>	<p>77</p>

M. A. Weber, J. Valentin	Präzise optische 3D-Messung von Mikro- und Nanostrukturen Untersuchung der Präzision des MPC-Messgerätes μ Surf	87
-----------------------------	--	----

Sitzung 3: Sensoren für die Präzisionsmesstechnik

B. Bodermann, H. Bosse, C. G. Frase, L. Koenders, G. Wilkening	Sensoren der Mikro- und Nanomesstechnik	99
S. Büttgenbach, U. Brand, S. Bütefisch, Ch. Herbst, T. Krah, A. Phataralaoha, R. Tutsch	Taktile Sensoren für die Mikromesstechnik	109
P. Lehmann	Geometrieerfassung an Mikrobauteilen mittels Weißlichtinterferometrie und konfokaler Mikrosensoren Messprinzipien, Anwendungen, Einschränkungen	119
Th. Thurner	Messtechniken mit objektiven Laser-Speckles	129
E. Westkämper, W. Osten, J. Regin, T. Wiesendanger	Multiskalige Mess- und Prüfstrategien in der Mikro- und Nanomesstechnik	141

Sitzung 4: Mikro- und Nanomesstechnik

W. Schott, W. Pöschel, D. Dontsov	Industrielle Anwendungen von laserinterferometrischen Nanomesssystemen	153
Th. Fries	Multi Sensor Oberflächenmesstechnik für die Nano- und Mikrotechnik	163
W. Rauh	Messen von Mikrostrukturen mit Multisensor-Koordinatenmessgeräten	173

Sitzung 5: Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften und Wechselwirkungen und deren Charakterisierung

<i>T. Machleidt, K.-H. Franke</i>	Methoden zur Rekonstruktion der AFM-Spitzenform Bestimmung der AFM-Spitzenform aus den Messdaten	187
<i>W. Unger, U. Oran, M. Senoner, M. Schmidt</i>	Chemische Charakterisierung von mikro- und nanotechnologischen Bauteilen: Verfahrensentwicklung und Referenzmaterialien	197
<i>A. Duparré, S. Schröder, A. Tünnermann</i>	Nano-Rauheitsanalyse an funktionalen Oberflächen	207
<i>M. Kosinskiy, Y. Liu, S. I.-U. Ahmed, M. Scherge, J. A. Schäfer</i>	Tribology of Nanopositioning Characterization of precision linear bearings on nanometre scale	215
<i>A. Albers, J. Fleischer, N. Burkardt, S. Hauser, I. Behrens</i>	Integration von Funktionsprüfung und dimensioneller Messtechnik zu einer optimierten QS-Strategie für Mikroverzahnungen	225